УДК 621.315.592

ISSN 1729-4428

В.А. Ромака^{1,2}, Ю.В. Стадник³, Д. Фрушарт⁴, Я. Тобола⁵

Особливості зонної структури та механізмів електропровідності напівпровідникового твердого розчину TiCo_{1-x}Cu_xSb

¹Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України,

вул. Наукова, 3-б, 79060, Львів, Україна;

²Національний університет "Львівська політехніка", вул. Кн. Романа, 1, 79005, Львів, Україна,

E-mail:vromaka@polynet.lviv.ua;

³Львівський національний університет ім. І.Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005, Львів, Україна;

⁴Лабораторія кристалографії Національного центру наукових досліджень, ВР 166, 38042 Гренобль, Франція;

⁵Науково-технологічний університет Гірничо-металургійної академії, 30-059 Краків, Польща.

Розраховано зонну структуру, розподіл електронної густини (DOS) та досліджено температурні і концентраційні залежності питомого електроопору, коефіцієнту термо-ЕРС та магнітної сприйнятливості напівпровідникового твердого розчину TiCo_{1-x}Cu_xSb в температурному інтервалі 80÷380 К. Експериментально виявлено передбачений розрахунками перехід провідності діелектрик-метал (перехід Андерсона).

Ключові слова: напівпровідник, донорна домішка, рівень Фермі, електропровідність.

Стаття поступила до редакції 29.10.2006; прийнята до друку 15.12.2007.

Вступ

Розрахунок електронних структур та експериментальні дослідження структурних, кінетичних, термоелектричних, магнітних та резонансних характеристик інтерметалічних напівпровідників зі структурою типу MgAgAs при легуванні їх значними концентраціями акцепторних і/або донорних домішок $(N_A, N_D \sim 10^{19} \div 10^{21} \text{ см}^{-3})$ дозволили вперше визначити механізми електропровідності для даного класу напівпровідників в широкому концентраційному та температурному інтервалах, встановити роль домішкових в провідності згаланих зон напівпровідників, запропонувати моделі перебудови домішкових зон та сформулювати умови досягнення максимальних значень коефіцієнту термоелектричної потужності Z^* ($Z^* = \alpha^2 \cdot \sigma$, де α – коефіцієнт термо-ЕРС, σ - питома електропровідність) [1-7].

Останній результат є надзвичайно актуальним і з практичної точки зору, оскільки інтерметалічні напівпровідники зі структурою типу MgAgAs є одними з найбільш перспективних на предмет їх використання В якості робочих елементів термоелектричних генераторів струму [8]. В даному контексті запропоновані дослідження виглядають логічними та актуальними особливо з огляду на можливе практичне використання отриманих результатів.

Зробимо зауваження, на яке будемо посилатися при обговоренні результатів експерименту. отримання інтерметалічних Технологія напівпровідників в переважній більшості відомих нам робіт полягає у сплавленні шихти вихідних компонентів з наступним неконтрольованим охолодженням розплаву. При цьому, частково реалізується один 3 шляхів отримання невпорядкованих (аморфних) твердих тіл [9], що призводить структурних розупорядкувань, до локальним деформаціям і, як наслідок, викликає модуляцію зон неперервних енергій. З іншого боку, в сильно легованому напівпровіднику енергетична схема через флуктуації значних концентрацій заряджених домішок має схожий вигляд [10].

В запропонованій роботі досліджувався вплив значних концентрацій донорних домішок на зміну електронної структури, поведінку питомого опору (ρ), коефіцієнту термо-ЕРС, магнітної сприйнятливості (χ) та просторове розташування атомів в елементарній комірці інтерметалічного напівпровідника *p*-TiCoSb при його легуванні шляхом заміщення атомів Со на Си. При цьому концентрація донорних домішок змінювалася від $N_D = 1,9 \cdot 10^{19}$ см⁻³ (x = 0,001) до $N_D = 7,6 \cdot 10^{21}$ см⁻³ (x = 0,4).

Методики розрахунку електронної структури TiCo_{1-x}Cu_xSb в рамках самоузгодженого методу Корінги-Кона-Ростокера в наближенні когерентного потенціалу (ККR-CPA-LDA), отримання зразків, їх структурні дослідження, вимірювання питомого електроопору, коефіцієнту термо-ЕРС по відношенню до міді, магнітної сприйнятливості (метод Фарадея) в області температур 80 ÷ 380 К наведені в [1].

I. Розрахунок електронної структури

На рис. 1 приведені результати розрахунку електронної густини (DOS) для кожного компоненту



Рис. 1. Розподіл електронної густини (DOS) в ТіСо_{1-х}Си_хSb. Сумарний DOS – суцільна лінія, вклади атомів Ті, Со та Sb – пунктир, крапки та шрих-пунктир, відповідно.

та сумарний розподіл DOS для різних значень xтвердого розчину TiCo_{1-x}Cu_xSb. З розрахунків слідує, що не леговані зразки TiCoSb є напівпровідниками, в яких енергетична щілина (E_g) між зоною провідності та валентною зоною утворюється в результаті сильної гібритизації *d*-станів перехідних елементів (Ті та Со): електронна густина зони провідності визначається головним чином *d*-станами Ті, в той час як валентна зона – *d*-станами Со, які перекриваються з *d*-станами Ті та *p*-станами Sb.

Як слідує з аналізу дисперсійних залежностей $E(\mathbf{k})$ (рис. 2), в інтерметалічному напівпровіднику



Рис. 2. Зонна структура та положення рівня Фермі в TiCo_{0.99}Cu_{0.01}Sb та TiCo_{0.7}Cu_{0.3}Sb.

TiCoSb енергетична шілина з'являється між точками Г та Х зони Бріллюена. Величина енергетичної щілини $E_g \approx 1 \text{ eB}.$ Рівень Фермі $(E_{\rm F})$ в напівпровіднику TiCoSb розташовується в забороненій зоні поблизу стелі валентної зони. Отриманий результат для TiCoSb співпадає з раніше отриманими за допомогою методів псевдопотенціалу та CPA-LDA [5].

Легування інтерметалічного напівпровідника ТіСоSb донорними домішками Cu призводить до дрейфу E_F в напямку зони провідності (рис. 1,2). Розрахунки показують, що вже при при $x \approx 0,01$ рівень Фермі розташовується на краю рухливості зони провідності. Подальше збільшення концентрації донорних домішок супроводжується входженням E_F в зону провідності та дрейфом в зоні неперервних енергій. Для концентрацій донорних домішок, що відповідають складу ТіСо_{0.7}Cu_{0.3}Sb, рівень Фермі розташовується глибоко в зоні провідності (рис. 1, 2). Розрахунок положення $E_{\rm F}$ та розподілу електронної густини при умові повної заміни в сполуці TiCoSb атомів Со на Си (гіпотетична сполука TiCuSb) призводить до зникнення забороненої зони в результаті перекриття зони провідності та валентної зони – утворення металу з властивим йому розташуванням рівня Фермі.

Як слідує з рис. 3, вклад різних компонентів напівпровідникового твердого розчину заміщення $TiCo_{1-x}Cu_xSb$ у сумарну величину електронної густини на рівні Фермі ($n(E_F)$) є різним. Введення в



Рис. 3. Вклад різних компонентів напівпровідникового твердого розчину ТіСо_{1-x}Cu_xSb у сумарну величину електронної густини на рівні Фермі.

напівпровідник TiCoSb вже незначних концентарції донорних домішок Cu призводить до різкого збільшення $n(E_{\rm F})$ головним чином через вклад *d*-станів Cu. При збільшенні концентрації донорних домішок Cu, що відповідають складам TiCo_{1-x}Cu_xSb, x > 0,1, вклад *d*-станів атомів Ti та Co в $n(E_{\rm F})$ збільшується, в той же час як вклад *d*- станів атомів Cu практично не змінюється.

Розрахунки показують, що найбільша зміна густини станів на рівні Фермі при легуванні інтерметалічного напівпровідника TiCoSb донорними домішками Си має місце при концентраціях домішок, що відповідають складам TiCo_{1-x}Cu_xSb, x < 0,1, що узгоджується з результатами, представленими на рис. 3.

З аналізу результатів, представлених на рис. 1 – 3, для випадку експериментальних досліджень зразків TiCoSb можна прогнозувати, що оскільки E_F в TiCoSb розташовується поблизу валентної зони, то ми маємо справу з аналогом напівпровідника діркового типу провідності, в якого рівень Фермі фіксується кулонівською щілиною домішкової акцепторної зони. В такому випадку, при дослідженні коефіцієнту термо-ЕРС повинна реалізуватися ситуація, при якій $\alpha > 0$.

Далі, оскільки рівень Фермі в $TiCo_{1-x}Cu_xSb, x < 0,01$, розташовується поза зонами неперервних енергій, електропровідність напівпровідника при

низьких температурах може носити активаційний характер – стрибковий механізм електропровідності по домішковій зоні (до металізації провідності в домішковій зоні [9]) та активація носіїв струму в зони неперервних енергій та на край рухливості зони провідності. При $x \ge 0,01$, коли $E_{\rm F}$ фіксується краєм рухливості зони провідності чи входить в зону неперервних енергій, дрейфуючи в ній, провідність TiCo_{1-x}Cu_xSb буде визначатися вільними електронами в досліджуваному температурному інтервалі.

Таким чином, легування інтерметалічного напівпровідника TiCoSb донорними домішками Cu призведе до зміни механізмів провідності – від активаційного до металічного (реалізація переходу Андерсона [10]), що зумовлюється перебудовою енергетичного спектру напівпровіника та дрейфом рівня Фермі від вершини зони провідності через заборонену зону з наступним входженням в зону та дрейфом по зоні провідності.

II. Результати експерименту та їх обговорення

Рентгенівські фазовий та структурний аналізи досліджуваних зразків підтвердили, що всі зразки ТіСо_{1-x}Cu_xSb є однофазними, а розподіл атомів в них відповідає структурному типу MgAgAs (просторова група $F\bar{4}$ 3*m*): 4Co в 4(*a*) 0 0 0 (Co +Cu); 4Sb в 4(*c*) ¹/₄ ¹/₄; 4 Ti в 4(*d*) ³/₄ ³/₄.

Температурна залежність питомого електроопору не легованого зразка *p*-TiCoSb (рис. 4) носить



Рис. 4. Температурні залежності питомого електроопору (ρ) ТіСо_{1-х}Си_хSb для різних концентрацій донорних домішок, що відповідають складам *х*: 1- 0; 2 - 0,001; 3 - 0,005; 4 - 0,02; 5 - 0,3; 6 - 0,4.

активаційний характер. На залежності $\ln \rho(1/T)$ мають місце кілька активаційних ділянок, які для випадку слабо легованих напівпровідників, в яких відсутні модуляції зон неперервниїх енергій, можна пов'язати з активацією електронів з E_F в

нелокалізовані стани зони провідності (високі температури), активацією електронів з E_F на край рухливості зони провідності (проміжні температури) та стрибковою провідністю (область низьких температур).

Висновок про напівпровідниковий характер провідності *p*-TiCoSb підтверджується також температурною залежністю коефіцієнту термо-ЕРС



Рис. 5. Температурні залежності коефіцієнту термо-ЕРС (α) ТіСо_{1-х}Си_хSb для різних концентрацій донорних домішок, що відповідають складам x: 1 – 0; 2 – 0,001; 3 – 0,005; 4 – 0,02; 5 – 0,3; 6 – 0,4.

(рис. 5). Додатній знак коефіцієнту термо-ЕРС при $T \le 85 \text{ K}$ і від'ємний при T > 85 K свідчить, що досліджуваний зразок є сильно компенсованим і містить значні концентрації неконтрольованих донорних та акцепторних домішок. Зауважимо, що рентгенівські фазовий та структурний аналізи не виявили у зразку іншої фази окрім TiCoSb.

З високотемпературних ділянок залежностей ln $\rho(1/T)$ та $\alpha(1/T)$ для *p*-TiCoSb визначені величини енергій активації ε_l^{ρ} та ε_l^{α} , відповідно, які в слабо легованих напівпровідниках дають величину енергетичного бар'єру між дном зони провідності та положенням рівня Фермі, який зафіксований кулонівською щілиною домішкової зони. Для *p*-TiCoSb розрахунки дають: $\varepsilon_l^{\rho} \approx 106$ меВ та $\varepsilon_l^{\alpha} \approx 196$ меВ. З точки зору фізики слабо легованих напівпровідників отриманий результат є протирічивим та незрозумілим.

Легування *p*-TiCoSb донорними домішками, що відповідають складам TiCo_{1-x}Cu_xSb ($x \ge 0,001$), призводить до ліквідації активаційних ділянок на

залежностях $\ln \rho(1/T)$ і можемо припустити, що провідність напівпровідника набуває типово металічного характеру вже при найменш досяжних в експерименті концентраціях донорних домішок Cu.

З іншого боку, як слідує з рис. 5, для досліджуваних зразків ТіСо_{1-x}Cu_xSb $0 \le x \le 0,02$ на залежностях $\alpha(1/T)$ мають місце ярко виражені активаційні ділянки. Крім того, легування напівпровідника *p*-TiCoSb донорними домішками призводить до зміни типу провідності з діркового на електронний при $T \le 85$ К. Це означає, що відбулася перекомпенсація напівпровідника і, як показуює розрахунок електронної структури ТіСо_{1-r}Cu_rSb, має місце дрейф рівня Фермі в напрямку зони провідності з наступним входженням в зону провідності.

Таким чином, отримуємо наступний протирічивий та незрозумілий результат: залежності ln $\rho(1/T)$ вказують на металічний механізм провідності сильно легованого напівпровідника TiCo_{1-x}Cu_xSb, а $\alpha(1/T)$ – напівпровідниковий.

З залежностей $\alpha(1/T)$ нами визначені величини енергій активації для різних концентрацій донорних домішок, що відповідають складам твердого розчину TiCo_{1-x}Cu_xSb: для $x = 0 \ \varepsilon_l^{\alpha} \approx 196$ меВ, x = 0,001 $\varepsilon_l^{\alpha} \approx 40$ меВ, $x = 0,005 \ \varepsilon_l^{\alpha} \approx 26$ меВ, x = 0,02 $\varepsilon_l^{\alpha} \approx 25$ меВ. Монотонне зменшення величини енергії активації з ростом концентрації донорних домішок для слабо легованих напівпровідників вказувало б на дрейф положення рівня Фермі в напрямку зони провідності, що повністю співпадає з результатами розрахунків.

Якісне обговорення отриманих експериментальних результатів, яке знімить протиріччя почнемо з того, що в силу зробленого вище зауваження щодо особливостей отримання інтерметалічних напівпровідників та значних концентрацій легуючих домішок, введених в напівпровідник, в досліджуваних зразках одночасно мають місце часткові розупорядкування [9] та флуктуації заряджених домішок [10], які викликають модуляцію зон неперевних енергій. Саме це, на нашу думку, є головною причиною спостережуваних відмінностей як між характером залежностей ln $\rho(1/T)$ та $\alpha(1/T)$, а також значної різниці між ε_l^{ρ} та ε_l^{α} для не легованого напівпровідника.

Приймаючи підходи авторів [10,11] для опису сильно легованих та сильно компенсованих напівпровідників, для початку визначемо принципову відмінність між електрокінетичним явищем провідності та термоелектричним коефіцієнтом термо-ЕРС для випадку сильно легованого напівпровідника, в якого має місце модуляція зон неперервних енергій. Якщо в слабо легованому напівпровіднику на носії струму діє лише одна зовнішня сила – градієнт температури ∇T , то в напрямку - ∇T виникає потік зарядів, який в силу стаціонарності системи, компенсується іншим потоком, який виникає в кристалі під впливом створеного в кристалі поля Е, а створена електрорушійна сила є коефіцієнт термо-ЕРС.

У випадку сильного легування напівпровідника крупномаштабні флуктуації концентрації домішки створюють потенціал, що набагато перевищує різницю потенціалів між двома точками в напівпровіднику при умові, що між ними підтримується градієнт температури. Таким чином, вимірювана величина ε_1^{α} в сильно легованому та компенсованому напівпровіднику співмірна усередненій амплітуді модуляції зон неперервних енергій.

Електропровідність напівпровідника в основному визначається концентрацією носіїв та їх рухливістю та існує лише при наявності зовнішнього електричного поля. Таким чином, вимірювана величина ε_l^{ρ} в сильно легованому та компенсованому напівпровіднику співмірна з енергетичною щілиною між рівнем Фермі та рівнем протікання.

Як висновок, в сильно легованому та компенсованому напівпровіднику величина ε_l^{α} змінюється на величину зміни амплітуди модуляції, а величина ε_l^{ρ} - на величину зміни взаємного розташування між рівнем Фермі та рівнем протікання.

Така логіка приводить до того, що величина ε_l^{α} повинна бути більшою за ε_l^{ρ} , що ми і спостерігаємо в експерименті ($\varepsilon_l^{\rho} \approx 106 \text{ меВ та } \varepsilon_l^{\alpha} \approx 196 \text{ меВ}$). Далі, введенні в напівпровідник незначних при концентрацій донорних домішок, концентрація яких не призводить до перекомпенсації напівпровідника з *p*- на *n*-тип провідності, збільшується ступінь компенсації напівпровідника і рівень Фермі змінюється, як $n^{2/3}$, а потенціальний рельєф зростає, оскільки електронне екранування послаблюється [10]. При повній компенсації напівпровідника $(N_A \approx N_D)$ амлітуда модуляцій зон неперервних енергій є максимальною і рівна половині ширини забороненої зони напівпровідника, рівень Фермі розміщується посередині забороненої зони [11]. В такій ситуації величина енергії активації ε_l^{ρ} з рівня Фермі на рівень протікання є максимальною і дорівнює тій же половині ширини забороненої зони. Той факт, що не легований напівпровідник p-TiCoSb змінює знак коефіцієнта термо-ЕРС з додатнього на від'ємний в досліджуваному інтервалі температур свідчить про близькість концентрацій акцепторів та донорів в напівпровіднику, а значить ступінь компенсації такого не легованого напівпровідника є максимально високим. В свою чергу амплітуда неперервних єнергій модуляції 30H € для вимірюваних зразків найбільшою саме для не (~ 196 меВ). легованого зразка Наявність ективаційної ділянки на залежності $\ln \rho(1/T)$ в не легованому p-TiCoSb вказує, що рівень протікання розташовується вище рівня Фермі на величину ~

106 меВ.

При перекомпенсації напівпровідника, подальше збільшення концентрації донорних домішок тепер вже в напівпровіднику електронного типу провідності, призведе до зменшення ступеню компенсації, збільшення енергії Фермі, як n^{2/3}, а потенціальний рельєф зменшиться через зменшення радіусу електронного екранування r₀. Саме таку динаміку зміни амплітуди модуляції зон неперервних енергій ми спостерігаємо в експерименті (x = 0,001 $\varepsilon_l^{\alpha} \approx 40 \text{ meB},$ x = 0.005 $\varepsilon_l^{\alpha} \approx 26$ меВ, x = 0.02 $\varepsilon_l^{\alpha} \approx 25$ меВ). Відсутність активаційних ділянок на залежностях $\ln \rho(1/T)$ для всіх легованих напівпровідників свідчить, що рівень Фермі та рівень протікання помінялися місцями – реалізувався перехід провідності діелектрик-металл (перехід Андерсона). Такий перехід, зокрема, був передбачений розрахунками.

З наведеного слідує, що не існує протирічь як в поведінці залежностей ln $\rho(1/T)$ та $\alpha(1/T)$, так і величин енергій активації, отриманих з цих залежностей, оскільки у випадку сильно легованих та компенсованих напівпровідників вони описують різні фізичні процеси.

Таким чином, представлені результати свідчать, що спостережуваний перехід провідності діелектрикметал в інтерметалічних напівпровідниках p-TiCoSb при легуванні донорними домішками Си є переходом Андерсона і відбувається при набагато менших концентраціях донорних домішок в порівнянні з раніше дослілженими випалками [4]. Співпаління результатів теоретичних розрахунків та основних результатів експерименту свідчить про адекватність запропонованої моделі зоннної структури інтерметалічного напівпровідника ТіСо_{1-х}Си_хSb. У випадках, де такого співпадіння не спостерігається, повинні бути внесені корективи в модель, зокрема врахування модуляції зон неперервних енергій, що є предметом наступних досліджень.

Робота виконана в рамках грантів Національної академії наук України (№ 0106U000594) та Міністерства освіти і науки України (№ 0106U001299, № 0106U005428).

Ромака В.А. – к. фіз.-мат. н., доцент, ст.н.с.; *Стадник Ю.В.* – к. х. н., пров. н. с.; *Фрушарт Д.* – доктор фізики, професор; *Тобола Я.* – доктор фізики, професор.

- [1] В.А. Ромка, Ю.В. Стаднык, М.Г. Шелепина, Д. Фрушарт, Л.П. Ромака, Ю.К. Гореленко. Особенности перехода проводимости металл-диэлектрик в узкощелевых полупроводниках структурного типа MgAgAs // ФТП, 40(2), сс. 136-141 (2006).
- [2] Yu.V. Stadnyk, V.A. Romaka, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, D. Fruchart, V.F. Chekurin. Metal-insulator transition induced by changes in composition in Zr_{1-x}Sc_xNiSn solid solution range // *Journal of Alloys and Compounds*, **400**, pp. 29-32 (2005).

- [3] В.А. Ромака, М.Г. Шеляпина, Ю.К. Гореленко, Д. Фрушарт, Ю.В. Стаднык, Л.П. Ромака, В.Ф. Чекурин. Особенности механизмов проводимости сильно легированных интерметаллических полупроводников *n*-ZrNiSn // ФТП, **40**(6), сс. 676-682 (2006).
- [4] В.А. Ромака, М.Г. Шеляпина, Ю.В. Стаднык, Д. Фрушарт, Л.П. Ромака, В.Ф. Чекурин. Роль примесной зоны при переходе проводимости диэлектрик-металл при изменении состава сильно легированного и компенсированного полупрооводникового твердого раствора TiCo_{1-x}Ni_xSb. Донорные примеси // ФТП, 40(7), сс. 796-801 (2006).
- [5] L.P. Romaka, M.G. Shelyapina, Yu.V. Stadnyk, D. Fruchart, V.A.Romaka. Pecularity in metal-insulator transition due to composition change in semiconducting TiCo_{1-x}Ni_xSb solid solution. I. Electronic structure calculations // Journal of Alloys and Compounds, 416, pp. 46-50 (2006).
- [6] Yu.V. Stadnyk, V.A. Romaka, M.G. Shelyapina, D. Fruchart, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, A.V. Tkachuk, V.F. Chekurin. Impurity band effect on TiCo_{1-x}Ni_xSb conduction. Donor impurities // Journal of Alloys and Compounds, 421, pp. 19-23 (2006).
- [7] В.А. Ромака, Д. Фрушарт, М.Г. Шеляпина, Ю.В. Стаднык, В.Ф. Чекурин, Л.П. Ромака, Ю.К. Гореленко. Условия достижения максимальных значений коэффициента термоэлектрической мощности в интерметаллических полупроводниках структурного типа MgAgAs // ФТП, 40(11), сс. 1309-1315 (2006).
- [8] G.S. Nolas, J. Poon, M. Kanatzidis. Recent Developments in Bulk Thermoelectric Materials // MRS Bulletin, 8(3), pp. 199-205 (2006).
- [9] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. 368 с. (1982).
- [10] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников. Наука, М. 416 с. (1979).
- [11] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Полностью компенсированный кристаллический полупроводник как модель аморфного полупроводника // ЖЭТФ, **62**, с. 1156-1168 (1972).

V.A. Romaka^{1,2}, Yu.V. Stadnyk³, D. Fruchart⁴, J. Tobola⁵

Peculiarity in Band Structure and Conductivity Mechanisms in Heavily-Doped TiCo_{1-x}Cu_xSb Solid Solution

¹Ya. Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics

National Academy of Sciences of Ukraine, 79060 Lviv, Ukraine;

²National University "Lvivska Politechnika", 79013 Lviv, Ukraine;

³Ivan Franko Lviv National University, 79005 Lviv, Ukraine;

⁴Laboratoire de Cristallographie, CNRS, 38042 Grenoble, France;

⁵AGH University of Science and Technology, 30-059 Krakow, Poland;

Calculation of the band structure and distribution of electronic density (DOS) of the TiCoSb intermetallic semiconductor were performed at it doping with donor impurities by way of substituting Co atoms by Cu ones. Temperature and concentration dependences of electro-conductivity, thermopower of p-TiCoSb semiconductor were investigated at various concentrations of donor impurities in the 80 - 380 K temperature range. An insulator-metal transition of the conduction forecasted by the model calculation in the ZrNi1-xCuxSn solid solution alloys (Anderson transition) is caused by the displacement of the Fermi level from the impurity donor band to the conduction band as the donor impurity concentration increases.

Key words: semiconductor, donor impurity, Fermi level, electrical conduction.